

## 第26回（2010B）利用研究課題の採択について

登録施設利用促進機関  
財団法人高輝度光科学研究センター  
利用業務部

財団法人高輝度光科学研究センター（JASRI）では、利用研究課題審査委員会（PRC）において利用研究課題を審査した結果を受け、以下のように第26回共同利用期間（2010B）2010年10月7日～2011年2月22日（全期間264シフト、1シフト＝8時間）における利用研究課題を採択しました。ただし、産業利用Ⅰ、ⅡおよびⅢビームライン（BL14B2、BL19B1およびBL46XU）は2010Bを2期に分けて募集しており、これらのビームラインについては第1期の2010年10月7日～2010年12月21日（165シフト）における課題を採択しました。表1に利用研究課題公募履歴を示します。

### 1. 募集、選定および採択の日程

〔募集案内公開と応募締切〕

平成22年5月10日 SPring-8ホームページで募集案内公開  
(利用者情報5月号に募集案内記事を掲載)

6月16日 成果公開優先利用課題応募締切

6月17日 長期利用課題応募締切

7月1日 一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題および重点産業利用課題応募締切

〔課題審査、選定、採択および通知〕

平成22年8月3日午後～4日午前  
分科会による課題審査  
(一部 別日程)

8月4日午後  
利用研究課題審査委員会による課題審査選定

8月19日 JASRIとして採択決定し応募者に審査結果を通知

### 2. 応募および採択状況

上記締め切りまでの全応募課題数は866、採択課題数は612でした。表2に2010B期の利用研究課題の課題種別の応募課題数および採択課題数と採択率(%)を示します。なお、重点産業利用課題のうち産業利用Ⅰ、ⅡおよびⅢの3本のビームラインは、各利用期をさらに2期に分けて課題を募集しており、表2に示す値は2010B全期間のものにはならないことに注意してください。また重点ナノテクノロジー支援課題は一般課題との重複申請が認められていますので、重点課題として不採択になっても重複申請した一般課題で採択されている場合があります。

2010B期における成果非専有一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題および長期利用課題への応募792件について、ビームラインごとの応募課題数、採択課題数および採択率ならびに配分シフト数と採択された課題の1課題あたりの平均配分シフト数を表3に示します。また表4に、全応募866課題の申請者の所属機関の分類と課題の研究分野分類の統計を示します。図1および図2は、応募と採択課題数について、それぞれ機関分類および研究分野別の全体に対する割合を示します。

### 3. 採択課題

2010B期に採択された課題の一覧は、SPring-8ホームページに掲載しています。以下をご覧ください。

ホーム>利用案内>研究課題>採択・実施課題一覧  
<http://www.spring8.or.jp/ja/users/proposals/list/>  
なお、2010B期に新規に採択された長期利用課題の紹介は本誌311ページに掲載しています。

表1 利用研究課題 公募履歴

利用期	利用期間	ユーザ-利用シフト*	応募締め切り**	応募課題数	採択課題数
第1回：1997B	平成9年10月-平成10年3月	168	平成9年1月10日	198	134
第2回：1998A	平成10年4月-平成10年10月	204	平成10年1月6日	305	229
第3回：1999A	平成10年11月-平成11年6月	250	平成10年7月12日	392	258
第4回：1999B	平成11年9月-平成11年12月	140	平成11年6月19日	431	246
第5回：2000A	平成12年2月-平成12年6月	204	平成11年10月16日	424	326
第6回：2000B	平成12年10月-平成13年1月	156	平成12年6月17日	582	380
第7回：2001A	平成13年2月-平成13年6月	238	平成12年10月21日	502	409
第8回：2001B	平成13年9月-平成14年2月	190	平成13年5月26日	619	457
第9回：2002A	平成14年2月-平成14年7月	226	平成13年10月27日	643	520
第10回：2002B	平成14年9月-平成15年2月	190	平成14年6月3日	751	472
第11回：2003A	平成15年2月-平成15年7月	228	平成14年10月28日	733	563
第12回：2003B	平成15年9月-平成16年2月	202	平成15年6月16日	938	621
第13回：2004A	平成16年2月-平成16年7月	211	平成15年11月4日	772	595
第14回：2004B	平成16年9月-平成16年12月	203	平成16年6月9日	886	562
第15回：2005A	平成17年4月-平成17年8月	188	平成17年1月5日	878	547
第16回：2005B	平成17年9月-平成17年12月	182	平成17年6月7日	973	624
第17回：2006A	平成18年3月-平成18年7月	220	平成17年11月15日	916	699
第18回：2006B	平成18年9月-平成18年12月	159	平成18年5月25日	867	555
第19回：2007A	平成19年3月-平成19年7月	246	平成18年11月16日	1099	761
第20回：2007B	平成19年9月-平成20年2月	216	平成19年6月7日	1007	721
第21回：2008A	平成20年4月-平成20年7月	225	平成19年12月13日	1009	749
第22回：2008B	平成20年10月-平成21年3月	189	平成20年6月26日	1163	659
第23回：2009A	平成21年4月-平成21年7月	195	平成20年12月11日	979	654
第24回：2009B	平成21年10月-平成21年2月	210	平成21年6月25日	1076	709
第25回：2010A	平成22年4月-平成22年7月	201	平成21年12月17日	919	665
第26回：2010B	平成22年10月-平成23年2月	210	平成22年7月1日	(866)	(612)

\*ユーザ利用へ供出するシフト（1シフト＝8時間）で全ビームタイムの80%

\*\*一般課題の応募締め切り日

応募・採択課題数について：

2006B以前は応募締め切り日\*\*の値である。

2007A以降は、産業2期募集、生命科学等分科会留保課題、時期指定課題、緊急課題を含む期終了時の値。

2010Bは重点産業ビームライン3本について今後第2期分が選定されるため、現在の値は括弧内に示す。

長期利用課題の採択数の取り扱いについて：08A期は2件で3ビームライン（3課題）とカウント。05Bは3件4BL

（4課題）採択になったが1件（1課題）はビームタイムの配分なし。00Bは3件4BL（4課題）採択

表2 2010B 課題種別応募および採択課題数と採択率

課題種	成果専有/非専有	応募課題数	採択課題数	採択率(%)
一般課題	非専有	594	394	66.3
成果専有課題（一般課題）	専有	37	37	100.0
萌芽的研究課題	非専有	31	17	54.8
重点ナノテクノロジー支援課題	非専有	68	48	70.6
重点産業利用課題	非専有	97	78	80.4
成果公開優先利用課題	非専有	37	37	100.0
長期利用課題	非専有	2	1	50.0
総計		866	612	70.7
審査対象課題のみの合計		792	538	67.9

注1：重点産業利用ビームライン3本の統計は第1期申請分である（2010B第2期分は11月に決定）

注2：重点産業利用課題に応募したが一般課題で採択された6課題は、統計上一般課題に分類

注3：審査対象課題は成果専有課題と優先利用課題を除いた課題

注4：重点ナノテクノロジー支援課題と一般課題の二重申請について

重点ナノテクノロジー支援課題が採択されたので二重申請の一般課題が不採択となったのは35課題である。

この数を応募数から引いて計算した実質採択率は一般課題（非専有）70.5%、審査課題のみは71.1%、および全課題では73.6%である。

表3 2010B ビームラインごとの審査対象課題\*の採択状況

ビームライン	応募計	採択計	採択率	実質採択率**	審査対象課題配分シフト***計	1課題あたり平均配分シフト***
BL01B1 : XAFS	52	25	48.1	48.1	156	6.2
BL02B1 : 単結晶構造解析	14	13	92.9	92.9	135	10.4
BL02B2 : 粉末結晶構造解析	47	36	76.6	90.0	153	4.3
BL04B1 : 高温高圧	21	13	61.9	61.9	156	12.0
BL04B2 : 高エネルギーX線回折	27	23	85.2	85.2	210	9.1
BL08W : 高エネルギー非弾性散乱	24	16	66.7	66.7	210	13.1
BL09XU : 核共鳴散乱	22	10	45.5	45.5	156	15.6
BL10XU : 高圧構造物性	21	17	81.0	81.0	105	6.2
BL13XU : 表面界面構造解析	48	20	41.7	47.6	192	9.6
BL14B2 : 産業利用Ⅱ	23	19	82.6	82.6	78	4.1
BL17SU : 理研 物理科学Ⅲ	13	6	46.2	54.5	39	6.5
BL19B2 : 産業利用Ⅰ	24	23	95.8	95.8	138	6.0
BL20B2 : 医学・イメージングⅠ	32	14	43.8	43.8	105	7.5
BL20XU : 医学・イメージングⅡ	38	26	68.4	68.4	210	8.1
BL25SU : 軟X線固体分光	37	18	48.6	54.5	190	10.6
BL26B1 : 理研構造ゲノムⅠ	2	2	100.0	100.0	12	6.0
BL26B2 : 理研構造ゲノムⅡ	1	1	100.0	100.0	6	6.0
BL27SU : 軟X線光化学	27	21	77.8	87.5	189	9.0
BL28B2 : 白色X線回折	26	21	80.8	80.8	200	9.5
BL32XU : 理研 ターゲットタンパク	5	4	80.0	80.0	24	6.0
BL35XU : 高分解能非弾性散乱	19	16	84.2	84.2	210	13.1
BL37XU : 分光分析	38	21	55.3	63.6	171	8.1
BL38B1 : 構造生物学Ⅲ	35	33	94.3	94.3	183	5.5
BL39XU : 磁性材料	19	15	78.9	88.2	159	10.6
BL40B2 : 構造生物学Ⅱ	49	35	71.4	74.5	198	5.7
BL40X : 高フラックス	28	15	53.6	53.6	135	9.0
BL41XU : 構造生物学Ⅰ	30	30	100.0	100.0	109.5	3.7
BL43IR : 赤外物性	9	9	100.0	100.0	162	18.0
BL45XU : 理研 構造生物学Ⅰ	11	9	81.8	81.8	54	6.0
BL46XU : 産業利用Ⅲ	17	14	82.4	82.4	94	6.7
BL47XU : 光電子分光・マイクロCT	33	13	39.4	44.8	96	7.4
総計	792	538	67.9	71.1	4235.5	7.9

\* 成果非専有一般課題、萌芽的研究支援課題、重点ナノテクノロジー支援課題、重点産業利用課題、長期利用課題  
 \*\* 重点ナノテクノロジー課題は一般課題に二重申請可であるので、ナノテク採択のため一般課題不採択となったものを応募数から除いて計算した値である。  
 \*\*\* 1シフト=8時間  
 注：産業利用ビームライン3本は第1期分のみ統計である（2010B第2期分は11月に決定）

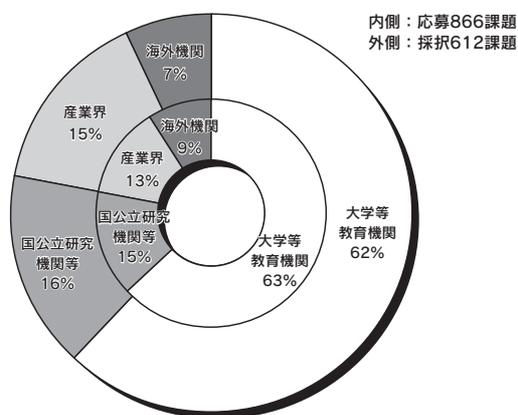


図1 2010B 応募・採択結果の期間分類  
産業利用ビームライン3本は第1期分のみ統計である。

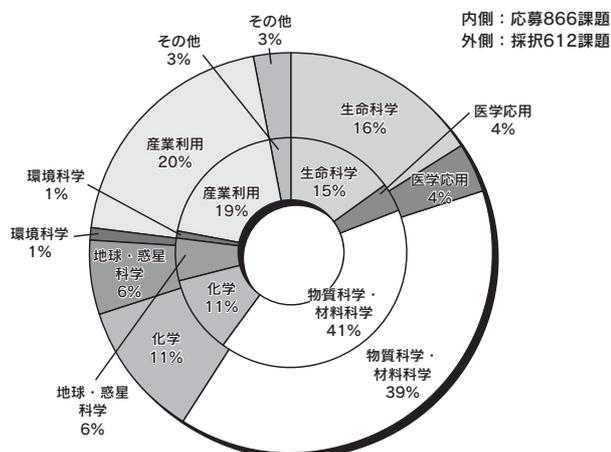


図2 2010B 応募・採択結果の研究分野分類  
産業利用ビームライン3本は第1期分のみ統計である。

表4 2010B 応募・採択結果の機関および研究分野分類

機関分類	課題分類	生命科学		医学応用		物質科学・材料科学		化学		地球・惑星科学		環境科学		産業利用		その他*		総計		課題採択率 (%)	
		応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択	応募	採択		
大学等教育機関	一般課題	課題数	93	77	14	3	171	108	59	41	39	25	4	3	16	8	3	2	399	267	66.9
		シフト数	515.5	385.5	139	24	1493	856	383	272	422	249	27	21	162	79	30	24	3171.5	1910.5	
	成果専有(一般)	課題数													3	3			3	3	
		シフト数													4	4			4	4	
	萌芽的研究課題	課題数	3	1	1	1	15	10	6	2	2	1	1	1			1	0	29	16	
		シフト数	24	6	10	9	137	60	36	12	18	9	6	6			12	0	243	102	
	重点ナノテクノロジー支援課題	課題数	3	1	4	4	41	31	5	3	1	1			4	1			58	41	
		シフト数	33	12	36	33	353	231	30	21	6	6			51	6			509	309	
	重点産業利用課題	課題数	1	1			7	4	3	1					1	1	1	1	34	26	
		シフト数	9	6			34	13	15	6			3	3	133	112	4	4	198	144	
成果公開優先利用課題	課題数	1	1			4	4	17	17	1	1			2	2			25	25		
	シフト数	6	6			36	36	159	159	12	12			9	9			222	222		
合計	課題数	101	81	19	8	238	157	90	64	43	28	6	5	46	32	5	3	548	378	69.0	
	シフト数	587.5	415.5	185	66	2053	1196	623	470	458	276	36	30	359	210	46	28	4347.5	2691.5		
一般課題	課題数	18	14	4	2	49	37			8	6	2	1	4	3	14	14	99	77		
	シフト数	159	108	33	17	618	477			84	48	14	9	39	24	153	138	1100	821		
成果専有(一般)	課題数	1	1											4	4			5	5		
	シフト数	14	14											4	4			18	18		
重点ナノテクノロジー支援課題	課題数			1	1	1	1			1	0			1	1			4	3		
	シフト数			12	12	6	6			6	0			15	15			39	33		
重点産業利用課題	課題数													6	5	1	1	7	6		
	シフト数													36	30	4	3	40	33		
成果公開優先利用課題	課題数	1	1			5	5	2	2					2	2			10	10		
	シフト数	24	24			54	54	18	18					6	6			102	102		
合計	課題数	20	16	5	3	55	43	2	2	9	6	2	1	17	15	15	15	125	101	80.8	
	シフト数	197	146	45	29	678	537	18	18	90	48	14	9	100	79	157	141	1299	1007		
一般課題	課題数	1	1			6	1	1	0					17	11			25	13		
	シフト数	9	9			45	3	3	0					130	96			187	108		
成果専有(一般)	課題数			1	1	3	3							25	25			29	29		
	シフト数			3	3	14	14							102	101			119	118		
重点ナノテクノロジー支援課題	課題数					1	1							1	1			2	2		
	シフト数					9	9							6	6			15	15		
重点産業利用課題	課題数					7	7							49	39			56	46		
	シフト数					44	38							315	245			359	283		
成果公開優先利用課題	課題数					1	1							1	1			2	2		
	シフト数					6	6							6	3			12	9		
合計	課題数	1	1	1	1	18	13	1	0					93	77			114	92	80.7	
	シフト数	9	9	3	3	118	70	3	0					559	451			692	533		
一般課題	課題数	4	2	10	10	42	22	2	1	3	1	2	0	5	0	3	1	71	37		
	シフト数	57	24	102	81	633	267	30	15	33	15	24	0	57	0	30	9	966	411		
萌芽的研究課題	課題数					2	1											2	1		
	シフト数					33	12											33	12		
重点ナノテクノロジー支援課題	課題数					3	2					1	0					4	2		
	シフト数					27	12					12	0					39	12		
長期利用課題	課題数	2	1															2	1		
	シフト数	117	42															117	42		
合計	課題数	6	3	10	10	47	25	2	1	3	1	3	0	5	0	3	1	79	41	51.9	
	シフト数	174	66	102	81	693	291	30	15	33	15	36	0	57	0	30	9	1155	477		
一般課題	課題数	128	101	35	22	358	238	95	67	55	35	11	6	161	124	23	19	866	612		
	シフト数	967.5	636.5	335	179	3542	2094	674	503	581	339	86	39	1075	740	233	178	7493.5	4708.5		
課題採択率 (%)		78.9		62.9		66.5		70.5		63.6		54.5		77.0		82.6		70.7			

\* ビームライン技術、素粒子・原子核、考古学

注：産業利用ビームライン3本は第1期分のみ統計である。2010B第2期分は11月に決定。産業利用と産業界の割合が増加する見込み。